



HALO LP H₂O

微量水分分析仪

气体和化学品

CEMS

能量

大气

半导体和HB LED

合成气

实验室和生命科学

专为微量水分分析而设计的HALO LP H₂O为您提供:

- NH₃和PH₃中低至十亿分之一 (ppb) 级水分检测能力
- 绝对值测量 (不受校准气体影响)
- 低运营成本, 且易于操作和维护
- 超宽的动态范围-超过4个数量级
- 简洁技术
- 紧凑的设计
- 用户可编程报警, 可立即通知紧急事件

氢化物气体中的纯微量水分检测

半导体和高亮度LED制造商依靠超高纯度工艺气体 (如氨和磷化氢) 来构建高科技产品, 如智能手机, LED电视和灯泡, 以及消费者所需的CPU和内存芯片。这些关键气体中的残留水分会降低设备性能, 降低产量, 并对产品和企业盈利能力产生负面影响。 HALO LP H₂O分析仪旨在为用户提供简单, 经济, 紧凑设计的分析仪, 确保NH₃和PH₃中的痕量水分符合要求的规格。

结合绝对压力控制器, 该分析仪的LP (低压) 版本允许用户测量氢化物气体中的水分, 具有无与伦比的准确性, 可靠性和响应速度。我们的全球1600多个传感器安装基础证明, 用户可以免受诸如定期传感器维护, 量程校准, 净化器更换以及其他技术常见的泵改造等要求的限制。因此, Tiger Optics' 的HALO LP H₂O成为全球电子制造商和特种气体供应商检测氨和磷化氢中微量水分含量的行业领导者。

HALO LP H₂O

微量水分分析仪



性能	
检测范围	见下面表格
检测极限(LDL, 3σ/24h)	见下面表格
精确度 (1σ, greater of)	± 1% 或 1/3 的 LDL
精度 (大于)	± 4% 或 LDL
响应速度	< 3 分钟到 95%
环境条件	10°C 到 40°C 30% 到 80% RH (非冷凝)
储存温度	-10°C 到 50°C

气体处理系统和条件*	
浸湿材料	316L 不锈钢 (腐蚀性气体可选)
	10 Ra 表面光洁度
气体接头	1/4" 凸 VCR 入口和出口
泄漏测试	1 x 10 ⁻⁹ mbar l / 秒
入口压力	10 – 125 psig (1.7 – 9.6 bara)
出口压力	< 10 Torr (13 mbar)
流速	Up to 1.0 slpm
样品气	NH ₃ , PH ₃ , 惰性气体
气体温度	高达 60°C

性能, H ₂ O:	范围	检测极限 (3σ)	精确度 (1σ) @ 0
氨气	0 – 20 ppm	9 ppb	3 ppb
磷化氢	0 – 10 ppm	9 ppb	3 ppb
氮气	0 – 6 ppm	1.0 ppb	0.3 ppb
氩气	0 – 4 ppm	1.0 ppb	0.3 ppb

*需要真空源
*需要低泄漏率真空泵
*请联系我们获取更多的分析物和基质。
美国专利 # 7,277,177

Tiger Optics, LLC
250 Titus Avenue, Warrington, PA 18976
www.tigeroptics.com

尺寸	H x W x D [英寸 (毫米)]
标准仪器 (包括截流阀)	8.73 x 8.57 x 26.4 (222 x 218 x 670)
仪器支架 (可容纳两部仪器)	8.73 x 19.0 x 26.4 (222 x 483 x 670)

重量	
标准仪器	33 lbs (15.0 kg)

电气	
报警指示器	2 个用户可编辑 1 系统故障警报 C型继电器
电源要求	90 – 240 VAC, 50/60Hz
电源消耗	最大 40W (不包括真空泵)
信号输出	孤立 4–20 mA
用户界面	5.7" LCD 触摸屏 10/100 Base-T 以太网 RS-232 802.11g 无线 (可选)



广思科技
Quest Technology

www.quest-tech.com.cn
电话: 86-21-58397708/86-21-58397706
传真: 86-21-58397825